© 2019 ІМФ (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України) Надруковано в Україні. Фотокопіювання дозволено тільки відповідно до ліцензії

PACS numbers: 61.05.cp, 61.72.Dd, 61.72.Ff, 68.37.Ps, 68.55.J-, 68.55.Nq, 81.15.Cd

# Вплив умов одержання на структуру та морфологію поверхні тонких плівок β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> й (Y<sub>0.06</sub>Ga<sub>0.94</sub>)<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

О. М. Бордун, Б. О. Бордун, І. Й. Кухарський, І. І. Медвідь, О. Я. Мильо, М. В. Партика, Д. С. Леонов<sup>\*</sup>

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 50, 79005 Львів, Україна \*Texнічний центр НАН України, вул. Покровська, 13, 04070 Київ, Україна

Досліджено структуру, фазовий склад і морфологію поверхні тонких плівок  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> та (Y<sub>0,06</sub>Ga<sub>0,94</sub>)<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, одержаних методою високочастотного йонно-плазмового розпорошення у різних атмосферах термооброблення. Показано, що процеси спікання та росту кристалітів істотніше проявляються у плівках (Y<sub>0,06</sub>Ga<sub>0,94</sub>)<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, порівняно з плівками  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

The structure, phase composition, and surface morphology of thin  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and  $(Y_{0.06}Ga_{0.94})_2O_3$  films obtained by high-frequency ion-plasma sputtering in different atmospheres of heat treatment are investigated. As shown, the processes of sintering and growth of crystallites are taking place more considerably in  $(Y_{0.06}Ga_{0.94})_2O_3$  films as compared with  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> films.

Исследована структура, фазовый состав и морфология поверхности тонких плёнок  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и (Y<sub>0,06</sub>Ga<sub>0,94</sub>)<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, полученных методом высокочастотного ионно-плазменного распыления в различных атмосферах термообработки. Показано, что процессы спекания и роста кристаллитов более существенно проявляются в плёнках (Y<sub>0,06</sub>Ga<sub>0,94</sub>)<sub>2</sub>O<sub>3</sub> по сравнению с плёнками  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Ключові слова: оксид ґалію, тонкі плівки, кристаліт.

Key words: gallium oxide, thin films, crystallite.

Ключевые слова: окись галлия, тонкие плёнки, кристаллит.

(Отримано 6 грудня 2018 р.)

123

#### 1. ВСТУП

На даний час інтерес до металооксидних матеріялів зумовлений необхідністю пошуку нових функціональних середовищ в оптоелектроніці, які використовуються при створенні дисплеїв, сцинтиляторів, засобів для запису та візуалізації інформації. В цьому плані широке застосування у якості тонкоплівкових матеріялів набувають плівки на основі β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, які є перспективними для люмінесцентних дисплеїв, польових транзисторів, газових сенсорів і електрод, прозорих в УФ-області [1-5]. В загальному, оптичні та електричні характеристики тонких плівок β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> визначаються методами їх одержання, режимами нанесення і технологією оброблення, а також введенням домішок, які здатні цілеспрямовано змінювати спектрально-люмінесцентні й електрофізичні властивості цих плівок. З цією метою в роботі досліджені тонкі плівки з хемічним складом (Y<sub>0.06</sub>Ga<sub>0.94</sub>)<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, у яких частину йонів Ga<sup>3+</sup> було заміщено ізовалентними йонами Y<sup>3+</sup>, що не вимагало локальної компенсації електричного заряду. Таке заміщення зумовлене тим, що плівки У<sub>2</sub>О<sub>3</sub> є також доволі перспективними з точки зору їх використання в оптоелектронній і люмінесцентній техніці [6-8] і уможливлює ліпше дослідити центри люмінесценції у тонких плівках на основі β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, оскільки ефективність люмінесценції в цих плівках у значній мірі визначається особливостями рекомбінаційних процесів, зумовлених, як правило, центрами свічення дефектного походження. Крім того, питання про фізичні властивості тонких плівок ускладнюється тим, що плівки не завжди мають досконалу структуру і можуть бути аморфними або полікристалічними, містити включення інших фаз. Одержання потрібних і стабільних відтворюваних властивостей полікристалічних плівок додатково ускладнюється наявністю міжзеренних меж (МЗМ). Взагалі-то, фізичні властивості полікристалічних тонких плівок визначаються в значній мірі не тільки властивостями матеріялу, але й енергетичними рівнями, які виникають через наявність M3M. Це і зумовило структурні дослідження тонких плівок  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> та (Y<sub>0.06</sub>Ga<sub>0.94</sub>)<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, яких наведено в даній роботі. Плівки одержано методом високочастотного (ВЧ) йонно-плазмового розпорошення, який є оптимальним для одержання однорідних напівпровідникових і діелектричних плівок.

#### 2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ

Тонкі плівки  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> та (Y<sub>0,06</sub>Ga<sub>0,94</sub>)<sub>2</sub>O<sub>3</sub> товщиною у 0,2–0,8 мкм було одержано ВЧ-йонно-плазмовим розпорошенням на підкладинках із топленого кварцу  $\upsilon$ -SiO<sub>2</sub>. ВЧ-розпорошення проводилося в атмосфері арґону у системі з використанням магнетного по-

ля зовнішніх соленоїдів для компресії та додаткової йонізації плазмового стовпа. Після нанесення плівок здійснювалось їх термооброблення в кисні або арґоні при 1000–1100°С, а також у водні при 600–650°С.

Методою рентґенодифракційної аналізи (Shimadzu XDR-600) досліджувалася структура та фазовий склад одержаних плівок після відпалу у різних атмосферах. Морфологія поверхні плівок досліджувалася за допомогою атомно-силового мікроскопа (ACM) 'Solver P47 PRO'. Опрацювання експериментальних даних і виконання обчислень параметрів морфології поверхні здійснювались за допомогою програмного пакету 'Image Analysis 2'.

За допомогою енергодисперсійного спектрометра OXFORD WCa Епеrgy 350 виконано елементну аналізу зразків у декількох точках на поверхні плівок. Розрахунки підтвердили відповідність процентного вмісту компонентів в одержаних плівках їхньому процентному вмісту у сполуці ( $Y_{0.06}Ga_{0.94}$ )<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

### 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Характерні дифрактограми одержаних плівок  $Ga_2O_3$  наведено на рис. 1. Згідно з даними рентґенівської дифракційної аналізи, для одержаних плівок  $\beta$ - $Ga_2O_3$  характерна полікристалічна структура, яка відрізняється залежно від способу термооброблення плівок. Результати свідчать про те, що при відпалі у кисні переважна орієнтація кристалітів  $\beta$ -фази спостерігається у площинах (400), (002), (111) і (512).

При відпалі в арґоні також переважає орієнтація кристалітів у площинах (400), (002), (111) і (512), але має місце відносне зменшення орієнтації в площині (400), збільшення в площині (111) і ріст орієнтації у новій площині (113). Для плівок, відпалених у водні, спостерігається слаборозвинута структура дифракційного спектру, у якому також переважають рефлекси від площин (400), (002) і (512). На дифрактограмах не виявлено рефлексів, які б не відповідали Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, тобто не виявлено наявности інших фаз. При цьому всі дифракційні максимуми ідентифікуються згідно з правилами відбору і відносяться до просторової групи C2/m ( $C_{2h}^3$ ), що свідчить про моноклінну структуру одержаних плівок, тобто про наявність плівок  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Характерні дифрактограми тонких плівок  $(Y_{0,06}Ga_{0,94})_2O_3$  наведено на рис. 2. Їх аналіза показує, що структура даних плівок також відповідає моноклінній кристалічній структурі  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Результати свідчать про те, що при відпалі у кисні переважна орієнтація плівок спостерігається у площинах (110), (002), (111) і (512). При відпалі в арґоні переважає орієнтація плівок у площинах (002) і (111) і має місце відносне зменшення орієнтації у



Рис. 1. Дифрактограма (при  $CuK_{\alpha}$ -опроміненні) тонких плівок  $Ga_2O_3$ , одержаних ВЧ-йонно-плазмовим розпорошенням, після термооброблення в атмосфері кисню (*a*), арґону (б) при 1000°С і водню при 600°С (*в*).<sup>1</sup>

площинах (110) і (512). Для плівок відпалених у водні, спостерігається перерозподіл одержаних рефлексів і орієнтація таких плівок переважає в площинах (201), (31 $\overline{1}$ ), (40 $\overline{3}$ ) і (31 $\overline{3}$ ). Окрім появи найбільш інтенсивного рефлексу від площини (201), який є характерним для структури β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, на дифрактограмі спостерігається рефлекс від площини (321), який є характерним для Y<sub>3</sub>Ga<sub>5</sub>O<sub>12</sub> [9]. Це свідчить про те, що в тонких плівках (Y<sub>0,06</sub>Ga<sub>0,94</sub>)<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, крім основної структурної фази β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, може спостерігатися при відпалі у водні наявність фази ітрій-ґалійового ґранату Y<sub>3</sub>Ga<sub>5</sub>O<sub>12</sub>. Це досить добре узгоджується із результатами досліджень діяграми стану системи Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> [10], де встановлено, що при вмісті у такій системі більше 65 мол.% Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> утворюється сукупність Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> і Y<sub>3</sub>Ga<sub>5</sub>O<sub>12</sub>.

У цій же роботі [10] встановлено, що при вмісті, щонайменше до 1,8 мол. % Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в такій системі спостерігається тільки структура Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Зміну структури виявлено при наявності більше 23,6 мол. % Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Таким чином, одержані нами результати дають мо-



Рис. 2. Дифрактограма (при  $CuK_{\alpha}$ -опроміненні) тонких плівок  $(Y_{0,06}Ga_{0,94})_2O_3$ , одержаних ВЧ-йонно-плазмовим розпорошенням, після термооброблення в атмосфері кисню (*a*), арґону (б) при 1000°С і водню при 600°С (*в*).<sup>2</sup>

жливість стверджувати, що в тонких плівках  $(Y_{0,06}Ga_{0,94})_2O_3$  після відпалу у кисні й арґоні їхня структура відповідає структурі β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, а при відновленні у водні у плівках спостерігається наявність фази  $Y_3Ga_5O_{12}$ .

Мікрофотографії поверхні плівок  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, одержані за допомогою ACM, наведено на рис. 3. Діяметер зерен на поверхні плівки без термооброблення в середньому рівний 30 нм (рис. 3, *a*), середня шерсткість поверхні плівки становить близько 7 нм (рис. 3, *b*). Оброблення в атмосфері, наприклад кисню, приводить до зростання розміру зерен за рахунок процесів їх росту та спікання, а їхній середній діяметер збільшується до 45 нм (рис. 3, *b*). Шерсткість поверхні плівок після відпалу зростає більш ніж у 2 рази, в середньому до 15 нм (рис. 3, *c*). В загальному було встановлено, що відпал тонких плівок  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в арґоні, кисні чи водні при високій температурі приводить до зростання розмірів зерен і появи нового, шерсткішого рельєфу поверхні плівок.



Рис. 3. Зображення морфології поверхні тонкої плівки  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> без термооброблення (*a*, *б*) і після термооброблення в атмосфері кисню при 1000°С (*в*, *г*). Зображення *a* і *в* — двовимірні, *б* і *г* — тривимірні.<sup>3</sup>



Рис. 4. Зображення морфології поверхні тонкої плівки  $(Y_{0,06}Ga_{0,94})_2O_3$  без термооброблення (*a*, *б*) і після термооброблення в атмосфері кисню при 1000°С (*в*, *г*). Зображення *a* і *в* — двовимірні, *б* і *г* — тривимірні.<sup>4</sup>



Рис. 5. Зображення морфології поверхні тонкої плівки  $(Y_{0,06}Ga_{0,94})_2O_3$ після термооброблення в атмосфері арґону при 1000°С (*a*, *б*) і атмосфері водню при 600°С (*b*, *c*). Зображення а і *b* — двовимірні, *б* і *c* — тривимірні.<sup>5</sup>

Подібна ситуація спостерігається і в тонких плівках  $(Y_{0,06}Ga_{0,94})_2O_3$  (рис. 4 і рис. 5). Діяметер зерен на поверхні плівки  $(Y_{0,06}Ga_{0,94})_2O_3$  без термооброблення в середньому рівний 16 нм (рис. 4, *a*), а середня шерсткість поверхні плівки становить близько 2 нм (рис. 4, *б*). Термооброблення даних плівок у різних атмосфера більш суттєво ніж у плівках  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> впливає на ріст кристалічних зерен і на шерсткість поверхні плівок. Зокрема, термооброблення, наприклад в атмосфері кисню, приводить до збільшення середнього діяметра зерен до 55 нм (рис. 4, *e*).

Термооброблення у водні збільшує середні розміри зерен на поверхні плівки  $(Y_{0,06}Ga_{0,94})_2O_3$  до 75 нм (рис. 5, *в*), а термооброблення в арґоні — до 110 нм (рис. 5, *а*). При цьому середня шерсткість поверхні плівок зростає до 7 нм (рис. 5, *г*) та до 12 нм (рис. 5, *б*) відповідно.

Одержані результати, визначені за даними ACM, наведено у табл. Вони свідчать, що при ВЧ-йонно-плазмовому розпорошенні введення у тонку плівку  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 6% Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> приводить до істотного зменшення розмірів зерен, які формують плівку і особливо до зменшення шерсткости поверхні плівки. При цьому, в процесі термооброблення у різних атмосфера процеси спікання та росту

Плівка	Атмосфера термооброблення	Середній діяметер зерна <i>D</i> , нм	Середня шерсткість поверхні Z, нм
$\beta$ -Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	без термооброблення	30	7
(Y <sub>0,06</sub> Ga <sub>0,94</sub> ) <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	без термооброблення	16	2
$\beta$ -Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	кисень	<b>45</b>	15
$(Y_{0,06}Ga_{0,94})_2O_3$	кисень	55	16
$(Y_{0,06}Ga_{0,94})_2O_3$	арґон	110	12
$(Y_{0.06}Ga_{0.94})_2O_3$	водень	75	7

**ТАБЛИЦЯ.** Середні діяметри зерен і шерсткість поверхні тонких плівок  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> та (Y<sub>0.06</sub>Ga<sub>0.94</sub>)<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.<sup>6</sup>

зерен більш істотно проявляються у плівках  $(Y_{0,06}Ga_{0,94})_2O_3$ . Наприклад, відпал у кисневій атмосфері при 1000°С приводить до збільшення розміру середнього діяметра зерна в тонких плівках  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> від 30 до 45 нм, тобто до зростання у 1,5 рази. В той же час, такий відпал у плівках  $(Y_{0,06}Ga_{0,94})_2O_3$  збільшує середній розмір зерен на поверхні плівки від 16 до 55 нм, тобто майже у 3,5 рази.

## 4. ВИСНОВКИ

Проведені дослідження показують, що при ВЧ-йонно-плазмовому напорошенні тонких плівок  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> та (Y<sub>0,06</sub>Ga<sub>0,94</sub>)<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в атмосфері арґону з наступним відпалом у атмосфері кисню, арґону чи водню формуються плівки полікристалічної структури, яка відповідає моноклінній модифікації  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Свіжонанесені плівки (Y<sub>0,06</sub>Ga<sub>0,94</sub>)<sub>2</sub>O<sub>3</sub> мають менші середні діяметри зерен і шерсткість поверхні відносно плівок Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. При цьому в процесі термооброблення процеси спікання та росту кристалічних зерен істотніше проявляються у тонких плівках (Y<sub>0,06</sub>Ga<sub>0,94</sub>)<sub>2</sub>O<sub>3</sub> відносно тонких плівок Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

# ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА-REFERENCES

- 1. C. Jin, S. Park, H. Kim, and C. Lee, Sensors and Actuators B, 161, No. 1: 223 (2012).
- 2. K. H. Choi and H. C. Kang, Materials Letters, 123: 160 (2014).
- 3. J.-T. Yan and C.-T. Lee, Sensors and Actuators B, 143, No. 1: 192 (2009).
- 4. L. Kong, J. Ma, C. Luan, W. Mi, and Yu Lv, *Thin Solid Films*, **520**, No. 13: 4270 (2012).
- 5. K. Shimamura, E. G. Villora, T. Ujiie, and K. Aoki, Appl. Phys. Lett., 92,

No. 20: 201914 (2008).

- 6. C. Shang, X. Shang, Y. Qu, and M. Li, Chem. Phys. Lett., 501, Nos. 4–6: 480 (2010).
- 7. P. Packiyaraj and P. Thangadurai, J. Lumin., 145: 997 (2014).
- O. M. Bordun, I. M. Bordun, and S. S. Novosad, J. Appl. Spectosc., 62, No. 6: 1060 (1995).
- A. Yousif, H. C. Swart, and O. M. Ntwaeaborwa, *Appl. Surf. Sci.*, 258, No. 17: 6495 (2012).
- 10. V. F. Popova, A. G. Petrosyan, E. A. Tugova, D. P. Romanov, and V. V. Gusarov, *Russian J. Inorganic Chem.*, **54**, No. 4: 624 (2009).

Ivan Franko National University of Lviv, 50, Drahomanov Str., 79005 Lviv, Ukraine \*Technical Centre, N.A.S. of Ukraine, 13, Pokrovska Str., 04070 Kyyiv, Ukraine

<sup>1</sup> Fig. 1. X-ray diffraction (at  $CuK_a$ -radiation) of thin  $Ga_2O_3$  films obtained by RF ion-plasma sputtering after annealing in oxygen atmosphere (*a*), argon ( $\delta$ ) at 1000°C, and hydrogen at 600°C ( $\epsilon$ ).

<sup>2</sup> Fig. 2. X-ray diffraction (at  $CuK_{\alpha}$ -radiation) of thin  $(Y_{0.06}Ga_{0.94})_2O_3$  films obtained by RF ion-plasma sputtering after annealing in oxygen atmosphere (a), argon (6) at 1000°C, and hydrogen at 600°C (s).

<sup>3</sup> Fig. 3. SEM micrographs of surface of thin  $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> films without annealing (a,  $\delta$ ) and after annealing in oxygen atmosphere at 1000°C (s, z). Images a and c are two-dimensional, and  $\delta$ and z are three-dimensional. <sup>4</sup> Fig. 4. SEM micrographs of surface of thin (Y<sub>0.06</sub>Ga<sub>0.94</sub>)<sub>2</sub>O<sub>3</sub> films without annealing (a,  $\delta$ )

<sup>4</sup> Fig. 4. SEM micrographs of surface of thin  $(Y_{0.06}Ga_{0.94})_2O_3$  films without annealing  $(a, \delta)$  and after annealing in oxygen atmosphere at 1000°C (a, z). Images a and c are twodimensional, and  $\delta$  and z are three-dimensional. <sup>5</sup> Fig. 5. SEM micrographs of surface of thin  $(Y_{0.06}Ga_{0.94})_2O_3$  films after annealing in argon

<sup>5</sup> Fig. 5. SEM micrographs of surface of thin  $(Y_{0.06}Ga_{0.94})_2O_3$  films after annealing in argon atmosphere at 1000°C (*a*,  $\delta$ ) and hydrogen atmosphere at 650°C (*s*, *z*). Images *a* and *s* are two-dimensional, and  $\delta$  and *z* are three-dimensional.

 $^6$  TABLE. Average grain diameters and surface roughness of thin  $\beta\text{-}Ga_2O_3$  and  $(Y_{0.06}Ga_{0.94})_2O_3$  films.